

整理番号 OH99000303 発送番号 505832

発送日 平成13年 9月25日 1 / 2

拒絶理由通知書

Sep. 25, 2001

特許出願の番号	平成11年 特許願 第113059号
起案日	平成13年 9月14日
特許庁審査官	横井 亜矢子 9706 2W00
特許出願人代理人	須田 篤 様
適用条文	第29条第2項、第37条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

### 理 由

#### 理由1

この出願は、下記の点で特許法第37条に規定する要件を満たしていない。

#### 記

本願の請求項1-3に係る発明、請求項4に係る発明、請求項5-6に係る発明は、それぞれ解決する課題を、試料内の平面的な特定物質分布を得ること、複数の試料に光源光を貫通させて複数の試料を同時にモニターすること、試料内の3次元的な特定物質分布を検出すること、としており、各々は異なっており各々の発明は特許法第37条第1号の関係を満たさない。

また、上記課題に対応した主要部も異なっており、各々の発明は特許法第37条第2号の関係を満たさない。

さらに、各々の発明は、特許法第37条第3号、第4号、第5号に規定する他のいずれの関係も満たさない。

この出願は特許法第37条の規定に違反しているので、請求項1乃至3以外の請求項に係る発明については同法37条以外の要件についての審査を行っていない。

#### 理由2

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

発送番号 505832

2 / 2

い。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項：1乃至3

刊行物：引用文献1及び3

備考：

試料にレーザ光等の光を照射して得られる透過像をCCD等のイメージセンサにより検出することは周知である（引用文献1参照、引用文献2の特に図面第7図及びそれに関する発明の詳細な説明中の記載参照、引用文献3の特に図面第10、11図及びそれに関する発明の詳細な説明中の記載参照）。また、培地に対して上記測定を行うことも引用文献2に記載されている。

## 引用文献等一覧

1. 特開平10-090163号公報
2. 特開平10-337176号公報
3. 特開昭55-080054号公報

この拒絶理由通知書についての問い合わせ、または本願について面接の希望がある場合は、

審査第一部材料分析（物理・診断分析）

横井

TEL:03-3501-6866

FAX:03-3501-0604

まで連絡下さい。

-----  
先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野   IPC第7版   G01N21/00-21/01  
                                  G01N21/17-21/61  
                                  C12M   1/34  
DB名               JOIS

・先行技術文献

特開平06-50727号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

整理番号 OH99000303 発送番号 003794

発送日 平成14年 1月15日 1 / 2

## 拒絶理由通知書

Jan. 15, 2002

特許出願の番号	平成11年 特許願 第113059号
起案日	平成14年 1月 4日
特許庁審査官	横井 亜矢子 9706 2W00
特許出願人代理人	須田 篤 様
適用条文	第29条第2項

&lt;&lt;&lt;&lt; 最 後 &gt;&gt;&gt;&gt;

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

## 理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項：1乃至3

刊行物：引用文献1乃至7

備考：

試料にレーザ光等の光を照射して得られる透過像をCCD等のイメージセンサにより検出することは周知であり（引用文献1、2参照、引用文献3の特に図面第7図及びそれに関する発明の詳細な説明中の記載参照、引用文献4の特に図面第10、11図及びそれに関する発明の詳細な説明中の記載参照）、引用文献1（特に第3頁右下欄第12-18行、第7頁右上欄第20行-右下欄第2行参照）にはX、Y、Zの3軸において投影画像を得て立体画像を形成することについても記載されている。

さらに、光を用いた試料の透過像測定において立体画像を得るための手段として、試料を光学素子に対して相対的に回転させながら測定を行うことも周知の技術事項である（引用文献5の特に図面第7-12図及びそれに関する発明の詳細な説明中の記載参照、引用文献6、7参照）。

発送番号 003794

2 / 2

引用文献等一覧

1. 特開平03-044765号公報
2. 特開平10-090163号公報
3. 特開平10-337176号公報
4. 特開昭55-080054号公報
5. 特開平05-269135号公報
6. 特開平08-243105号公報
7. 特開平10-033542号公報

<< 最後の拒絶理由通知とする理由 >>

1. 最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶の理由のみを通知する拒絶理由通知である。

この拒絶理由通知書についての問い合わせ、または本願について面接の希望がある場合は、

審査第一部材料分析（物理・診断分析）

横井

TEL:03-3501-6866

FAX:03-3501-0604

まで連絡下さい。